

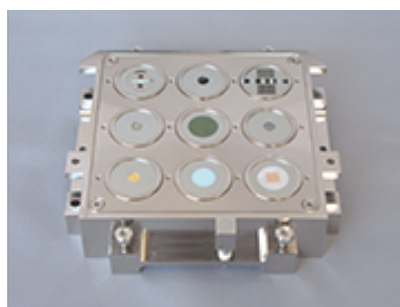
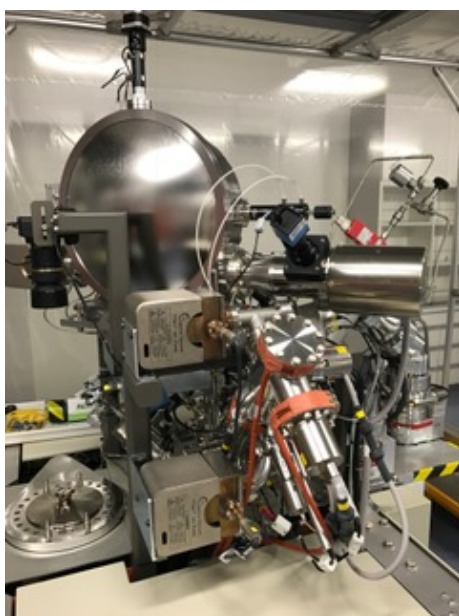
飛行時間型二次イオン質量分析装置

1. 装置の概要

固体試料にイオンビーム（一次イオン）を照射し、表面から放出されるイオン（二次イオン）を、その飛行時間差（飛行時間は重さの平方根に比例）を利用して質量分離する手法。TOF-SIMSでは、試料表面から1 nm以下の深さに存在する元素あるいは分子種に関する情報が、非常に高い検出感度で得ることが可能な非破壊な分析機器。

2. メーカー名・装置名称

アルバックファイ社・飛行時間型二次イオン質量分析装置(TOF-SIMS)



3. 用途

有機薄膜の表面解析および有機/有機界面の深さ組成解析

4. 仕様・構成

- ・ 1次イオン銃：液体金属イオン銃(LMIG：Liquid Metal Ion Gun、Bi イオン)
- ・ スパッタオン銃：アルゴンガスクラスタライオン(Ar-GCIB)
- ・ サンプルサイズ：< 10mm×10mm (9 枚)